УДК 534.2, 621.382

ISSN 1729-4428

В.П. Велещук¹, О.І. Власенко¹, О.В. Ляшенко², А. Байдулаєва¹, Б.К. Даулетмуратов¹

Акустична емісія та зміни люмінесцентних і електричних характеристик гетероструктур InGaN/GaN при струмовому навантаженні

¹Інститут фізики напівпровідників ім. В.С. Лашкарьова НАН України 03028, м.Київ, пр. Науки 45 ²Київський національний університет імені Тараса Шевченка 03680, м. Київ, пр. Акад. Глушкова 2/1 *E-mail:* <u>vyvit@ukr.net</u>

В роботі виявлено кореляцію виникнення акустичної емісії та змін люмінесцентних і електричних характеристик гетероструктур InGaN/GaN при навантаженні постійним прямим струмом, що вказує на їх загальний механізм походження. Показано, що кількість джерел акустичної емісії в гетероструктурах при протіканні критичних густин постійного прямого струму залежить від температури та значно збільшується з ростом температури.

Ключові слова: акустична емісія, гетероструктура, InGaN/GaN, дефект.

Стаття поступила до редакції 15.04.2007; прийнята до друку 15.12.2007.

Вступ

Тенденції зростання вимог до надійності напівпровідникових функціональних елементів та структур при їх експлуатації в екстремальних умовах та критичних режимах зумовлені широким їх застосуванням В енергозберігаючих та інформаційних технологіях [1-5]. Крім того в зв'язку з пошуком альтернативних надійних та ефективних джерел освітлення та інтенсивного короткохвильового випромінювання значно зріс практичний та науковий інтерес до люмінесцентних гетероструктур на основі сполук InGaN, AlGaN та GaN [1-10].

Проте однією з суттєвих проблем виготовлення та експлуатації при критичних режимах лазерних та діодних гетероструктур на основі сполук InGaN, AlGaN, GaN є неоднорідність провідності в об'ємі [3-6], різниця модулів пружних сталих, коефіцієнтів термічного розширення та сталих граток на границях гетеропереходів [5,6], теплового опору активного середовища та тепловідводу [7], що призводить до значного градієнту температур (1000°С/см-7000°С/см) і відповідно до значних термомеханічних напруг (до 10⁷ Па) при протіканні струму [11]. Це значно прискорює деградацію їх люмінесцентних та електричних характеристик, знижує коефіцієнт корисної дії, ефективність та тривалість функціонування [1-9,11]. Явище

нерівномірного розподілу густини струму в мезаструктурі відоме як "current crowding" [3,4] і призводить разом з вищеперечисленими причинами до значних термонапруг та небажаної локальної мікропластичності матеріалу при критичних густинах струму в умовах джоулевого саморозігріву. Дані локальні ділянки структури, де відбувається релаксація механічних напруг при протіканні струму є джерелами акустичної емісії (АЕ) – явища випромінювання пружних акустичних хвиль при динамічній перебудові структури матеріалу, що супроводжується зривом механічних напруг в локальних об'ємах, зокрема при виникненні та нерівномірному русі дислокацій в напівпровідниках [12] та напівпровідникових структурах [13-18].

Метою роботи було встановлення зв'язку між виникненням AE та змінами основних люмінесцентних та електричних характеристик в світловипромінюючих InGaN/GaN гетероструктурах при протіканні постійного прямого струму.

I. Експеримент

Об'єктом дослідження були InGaN/GaN світловипромінюючі мезаструктури з In_xGa_{1-x}N – квантовою ямою шириною 30 Å, в яких *n*-область структури була легована Si а *p*-область – Mg. Кристали мали площу гетеропереходу 400^x400 мкм² та розміщувались на сапфіровій підкладці (рис. 1).



Рис. 1. Енергетична діаграма та схема InGaN/GaN гетероструктури.

Для порівняння досліджувались також світлодіодні GaAs_{0,15}P_{0,85}:N, Zn-O/GaP структури. Структури були залиті компаундом – поліметилметакрилатом, вклад якого в виникнення AE при напруженностях електричного поля до 300 В/см та до температур 500 К як і в [16], виключався.

Сигнали AE реєструвались п'єзодатчиком та спеціалізованим акустоемісійним приладом AФ-15 у смузі частот 200-500 кГц при загальному підсиленні 69-73 дБ, надходили на комп'ютер та оброблялись.

Через зразки пропускався постійний електричний струм густиною $J_i = (2 \div 300) \text{ А/см}^2$; при тому що їх номінальні постійні струми I_n у прямому напрямку становлять 10÷20 мА ($J_n \sim 6 \div 12 \text{ А/см}^2$). Вольтамперні характеристики (ВАХ) вимірювались при постійному струмі з швидкістю ~ 40 мВ/хв. Вольт – фарадні характеристики (ВФХ) вимірювались на частоті 1 МГц. Спектри електролюмінесценції (ЕЛ) реєструвались ФЕУ-62 та оброблялись комп'ютером.

II. Результати

На рис. 2 дано послідовно записані спектри електролюмінесценції гетероструктури при номінальній густині струму (кр. 1) та при значно більших густинах струмів (кр.2-4), причому спектр 4 записувався одразу після АЕ. Видно, що після акустичної емісії інтенсивність спектру ΕЛ зменшилась вдвічі, що пояснюється в основному зростанням тунельної безвипромінювальної компоненти струму. Значний зсув максимуму спектру з 471 нм (2,62 eB) до 491 нм (2,51 eB) зумовлений розігрівом кристалу структури, а також змінами в профілі енергетичних рівнів за рахунок створених та частково релаксованих значних локальних механічних напруг [17,26].

На рис. 3 наведено вольт – фарадні характеристики InGaN/GaN гетероструктур (а) та GaAs_{0,15}P_{0,85}:N, Zn-O/GaP структур (б). Дані



Рис. 2. Спектри ЕЛ InGaN/GaN гетероструктури до (1, 2, 3) та одразу після AE (4). $1 - J = 12 \text{ A/cm}^2$, $2 - J = 31 \text{ A/cm}^2$, $3 - J = 56 \text{ A/cm}^2$, 4 -густина струму знизилась до 44 А/см², напруга *U* зросла з 5,2 В до 5,4 В при незмінній зовнішній напрузі.



гис. 5. БФХ структур після струмового навантаження: a) – InGaN/GaN, б) – GaAs_{0,15}P_{0,85}/GaP. 1 – без навантаження, 2 – 50 A/cm^2 , 3 – 75 A/cm^2 , 4 – 100 A/cm^2 , 5 – 125 A/cm^2 .

залежності вимірювались для різних зразків після їх витримки при різних величинах густин струмів протягом 10 - 15 хв. хвилин до виникнення сигналів акустичної емісії; вихідні ВФХ були однакові. Величина оберненого квадрату ємності $(1/C^2)$ лінійно залежить від напруги U, що дає змогу оцінити

концентрацію ефективну носіїв області просторового заряду $N_{e\phi} = \frac{n_n p_p}{(n_n + p_n)}$ та її зміну при збільшенні величини густини струму, при якій витримується гетероструктура до виникнення сигналів АЕ. Зміна ефективної концентрації носіїв структур після їх витримки при 125 А/см² становить $\Delta N_{e\phi} = N_{e\phi} - N_{e\phi 125} = 6,7 \cdot 10^{15}$ cm⁻³ - 3,74 · 10¹⁵ cm⁻³ = 2,96 · 10¹⁵ cm⁻³ для GaAs_{0,15}P_{0.85}/GaP структури та $\Delta N_{e\phi} = N_{e\phi} - N_{e\phi 125} = 1,19 \cdot 10^{17}$ cm⁻³ - 5,24 · 10¹⁶ cm⁻³ = 6,65·10¹⁶ см⁻³ для InGaN/GaN структури. Відмітимо, що в *p-n*- переходах GaP з вищою густиною дислокацій на інорідній підкладці Si ефективна концентрація носіїв по вимірах ВФХ нижча, ніж в структурах на підкладці GaP, в 3-5 раз [21], що є також результатом, подібним до нашого за умови дислокаційного механізму деградації [11,18-20]. Аналогічні зміни величини ємності та ефективного заряду по вимірах ВФХ зареєстровано в GaP: N структурах після їх опромінення у- квантами Co⁶⁰ [24].



Рис. 4. ВАХ гетероструктур InGaN/GaN a) після струмового навантаження протягом 10-15 хв. при 300 К до виникнення AE: 1 – без навантаження, 2 – 44 A/cm², 3 – 63 A/cm², 4 – 94 A/cm², 5 – 100 A/cm², 6 – 112 A/cm², 7 – 125 A/cm², 8 – 137 A/cm². T = 77 K; 6) при різних температурах тепловідводу: 1 – 300-310 K, 2 – 280 – 290 K, 3 – 180-200 K, 4 – 77 K.

На рис. 4 а наведено S-подібні вольт-амперні характеристики досліджуваних гетероструктур InGaN/GaN при 77 К. Аналогічно попереднім вимірюванням, характеристики вимірювались для різних зразків після їх витримки при різних струмах протягом 10-15 хвилин до виникнення сигналів акустичної емісії. Звертає увагу факт зникнення (виродження) S-подібної ділянки після витримки при густині струму в околі 94 А/см² та більше. Такий вигляд ВАХ при температурах нижчих 100 К є характерним для *p-i-n*-структур [27] та зумовлений наявністю глибокого рівня в *i*- області [10]. В InGaN/GaN структурах роль *i*- області відіграє InGaN квантова яма [10].

На рис. 4 б дано ВАХи різних гетероструктур при різних режимах тепловідводу - без тепловідводу - $T_{306H} = 300-310$ К (1) водяний тепловідвід, $T_{306H} = 280-$ 290 К (2), в парах азоту при T_{зовн} = 180-200 К та при зануренні в рідкий азот при Т_{зовн} = 77 К. Температура контролювалась термопарою. Bci чотири характеристики мають ділянку спаду струму одночасно з ростом прямої напруги, на якій має місце незворотне зростання послідовного опору R_s , причому на даних ділянках в перших трьох випадках реєструвалась АЕ. Реєстрація АЕ при T = 77 К через технічні складнощі не проводилась. Видно, що поріг незворотного росту опору, що відповідає порогу виникнення АЕ, є температурно залежним, що вказує на значне зменшення кількості джерел АЕ із зниженням температури.

III. Обговорення

Виникнення акустичної емісії завжди пов'язано з незворотними структурними змінами в матеріалі та, як показано раніше нами, є певним критерієм необоротності змін електрофізичних характеристик світловипромінюючих напівпровідникових структур [16,17].

В роботі по вивченню акустичної емісії в світловипромінюючих структурах на основі сполуки GaP при їх деградації в умовах впливу прямого постійного струму [18] було вперше ідентифіковано джерела АЕ, в ролі яких виступали дислокації. Проведені раніше у [14,17] дослідження вказують на наявність зв'язку між еволюцією спектрів електролюмінесценції, деградацією вольт-амперних характеристик та виникненням AE в світловипромінюючих структурах на основі сполук GaAsP та GaAlAs.

В умовах саморозігріву протікаючим струмом деградація світловипромінюючих гетероструктур в основному визначається температурою перегріву їх активної області [7,8]. При цьому деградація електрофізичних параметрів при протіканні густин струмів, що більші за номінальні, супроводжується появою одиничних дислокацій, в тому числі паралельних та перпендикулярних до площини гетеропереходу, та сітки дислокацій в активній області *p-n-* структури за рахунок релаксації неоднорідних термомеханічних напруг [11,18-20]. Причиною генерації механічних напруг може також бути металізація *p*- контакту гетероструктури [6]. Домінуючими при деградації світловипромінюючих структур є порушення типу скупчень точкових дефектів або дислокаційні сітки – джерела темних ліній та темних плям [11,18-20,23,24].

Відомо, що дислокації обумовлюють так звану надлишково-тунельну компоненту прямого струму в невироджених *p-n*-переходах, що виникає при створенні дефектів: при опроміненні електронами [26], нейтронами [23,26], гамма-квантами [24], за рахунок використання неузгодженості решіток гетеропари [21,22]. Дефекти створюють рівні в забороненій зоні і тим самим значно полегшують тунелювання крізь бар'єр [25,26]. В нашому випадку структурні дефекти, зокрема дислокації [18-20] створюються в активній області гетероструктури за рахунок релаксації неоднорідних термонапруг при струмовому навантаженні. Дислокації пронизують область об'ємного заряду структури, полегшують тунелювання носіїв і таким чином обумовлюють надлишково-тунельний струм [21,22]. Тільки (лінійно-протяжний дефект) дислокація може забезпечити неперервну просторову послідовність локалізованих станів на відстані характерної довжини тунелювання (приблизно 0,5-1 нм). Випадковим чином розташовані точкові дефекти повинні були б мати для цього густину 10²¹ см⁻³, тоді як відомо що тунельний струм спостерігається також в слабко легованих та некомпенсованих структурах [21,22].

Згідно роботі [21], величина ємності p-n- GaP/n-Si та *p-n-* GaP/*n-* GaP структур приблизно обернено пропорційна концентрації дислокацій в активній області, а прямий струм переходу має надлишковотунельну компоненту дислокаційного походження. В даній роботі запропоновано модель дислокаційного багатострибкового тунелювання шунта по дислокаційній лінії, що пронизує область об'ємного заряду *p-n-* переходу. Цим частково можна пояснити структури після спад ємності струмового навантаження. В роботі [24] по вимірах ВФХ зареєстровано спад ємності та величини N_{eb} електролюмінесцентних структур на основі сполук GaP після їх дозового радіаційного опромінення γквантами Co⁶⁰, що відповідає зростанню міжрівневих переходів і відповідно до зростання тунельної складової струму за рахунок багатократного міжрівневого тунелювання [24].

Крайові дислокації обумовлюють локальні поля пружних напруг в кристалічній решітці, що веде до флуктуацій ширини забороненої зони та енергетичних рівнів [26]. Порушені або ненасичені зв'язки дислокаційних ліній створюють просторові заряди та рівні енергії в забороненій зоні, в гетерополярних кристалах це переважно акцепторні та донорні рівні [26], окрім того дислокацію оточує просторовий заряд у вигляді трубки. В результаті цього зонна структура локально деформована, що наряду з появою нових енергетичних рівнів призводить до змін в механізмах проходження струму гетероструктури і відповідно до змін люмінесцентних та електричних властивостей, причому дані зміни різко залежать від густини дислокацій за рахунок їх взаємодії. Особливо чутливими до дислокацій є активна зона (в нашому випадку InGaN) та області гетеропереходів структури [6,9,18-22,25,26].

В досліджуваних InGaN/GaN структурах після поступової струмової деградації можливе утворення провідних каналів, ймовірно вздовж дефектних трубок, що шунтують *p-n*-гетероструктуру світлодіоду [6], крім того при деградації InGaN/GaN структури зростає струм витоку, причому різка нестабільність струму пов'язана даного перезарядкою граничних станів В ділянках гетеропереходу, що відіграють роль "затвора" каналу [6].

S-подібна ВАХ характерна для *p-i-n*-діодів при температурах нижче 100 К та може бути описана теорією Ешлі-Мілнса [27]. В ланій моделі високоомний розглядається напівпровідник 3 домішковою провідністю і з центрами компенсації, що частково заповнені електронами (акцептори). Положення рівня компенсації в забороненій зоні може бути довільним, проте рівень повинен бути достатньо глибоким, щоб концентрація термічно збуджених дірок була набагато менше концентрації самих центрів компенсації. В моделі припускається, що при пропусканні прямого струму центри компенсації в і- області відіграють роль центрів рекомбінації інжектованих електронів та дірок. Для щоб BAX мала ділянку з від'ємним того диференційним опором, необхідно щоб переріз захвату дірок σ_n був значно більше перерізу захвату електронів σ_n на центри рекомбінації [10,27].

Напруга початку від'ємного диференційного опору або напруга зриву S-BAX відповідає часу проходження дірок через *i*-область, що приблизно рівний часу їх життя. Як тільки дірки стануть проходити *i*-область без рекомбінації, характеристика раптово змінюється, тому що провідність з монополярного режиму інжекції носіїв перемикається в біполярну. Домішкові центри рекомбінації приписуються акцепторним рівням Mg [10].

зареєстрований Експериментально факт виродження та зникнення S подібної характеристики для InGaN/GaN структур після струмового навантаження з виникненням АЕ при $\sim 94 \text{ A/cm}^2$ і більше (рис. 4,а), що супроводжувалось різкою деградацією квантового виходу можна пояснити наступним чином. Утворені після струмової витримки дислокації та структурні дефекти утворюють в забороненій зоні активної області (InGaN) гетероструктури систему мілких акцепторних рівнів. А оскільки однією з умов наявності S – ВАХ є відсутність даної системи мілких рівнів [10], щоб не було нейтралізації об'ємного заряду акцепторів за рахунок термічно збуджених дірок то при наявності нових акцепторних рівнів в активній області S – подібний хід ВАХ зникає. Крім того, як було відмічено, тунельна складова прямого струму в бар'єрних гомо- та

обумовлена гетероструктурах протяжними дефектами (дислокаціями), що розміщені в області об'ємного заряду та які створюють просторово протяжну систему рівнів в забороненій зоні, і тим самим полегшують тунелювання крізь бар'єр, створений областю об'ємного заряду. Таким чином виродження та зникнення ділянки від'ємного диференційного опору на ВАХ при 77 К після певної величини струмового навантаження є наслідком часткової нейтралізації об'ємного заряду акцепторів та перерозподілу діркового струму між інжекційнорекомбінаційною складовою тунельною та складовою на користь останньої.

Відмітимо, що значні зсуви по струму та напрузі, тобто відмінності диференційного опору S-подібних ВАХ для різних зразків після їх струмового навантаження пояснюється індивідуальними відмінностями дефектної структури зразків, що є незначними та не проявляються при протіканні номінальних густин струмів, але сильно впливають на розкид електричних параметрів при даних величинах критичного струмового навантаження.

Висновки

В роботі виявлено кореляцію між процесами акустичної виникнення емісії та змінами люмінесцентних та електричних характеристик гетероструктур InGaN/GaN, а саме змінами інтенсивності електролюмінесценції, величини ємності та ефективного заряду, послідовного опору та змін в системі енергетичних рівнів в області просторового заряду при протіканні критичних густин постійного прямого струму, що вказує на загальний механізм їхнього походження.

Показано, що кількість джерел акустичної емісії в InGaN/GaN гетероструктурах, що може бути активована при протіканні постійного прямого струму, залежить від температури та значно збільшується з ростом температури.

Отримані результати можуть бути використані для індивідуального попереднього відбору світловипромінюючих гетероструктур InGaN/GaN та при контролі процесів їх катастрофічно-швидкої деградації при експлуатації в екстремальних та критичних режимах.

- [1] A. V. Kamanin, A. G. Kolmakov, P. S. Kop'ev, G. A. Onushkin, A. V. Sakharov, N. M. Shmidt, D. S. Sizov, A. A. Sitnikova, A. L. Zakgeim, R. V. Zolotareva, A. S. Usikov Degradation of blue LEDs related to structural disorder // *Physica Status Solidi* (c), 3(6), pp. 2129-2132 (2006).
- [2] T. Yanagisawa, T. Kojima. Degradation of InGaN blue light-emitting diodes under continuous and low-speed pulse operations // *Microelectronics Reliability*, **43**(6), pp. 977-980 (2003).
- [3] M. Shatalov, G. Simin, V. Adivarahan, A. Chitnis. Lateral current crowding in deep UV light emitting diodes over sapphire substrates // Jpn. J. Appl. Phys., 41(8), pp. 5083-5087 (2002).
- [4] X. Guo, E.F. Schubert. Current crowding in GaN/InGaN light emitting diodes on insulating substrates // J. Appl. *Phys.*, **90**(8), pp. 4191-4195 (2001).
- [5] Д.С. Сизов, В.С. Сизов, Е.Е. Заварин, В.В. Лундин, А.В. Фомин, А.Ф. Цацульников, Н.Н. Леденцов. Кинетика и неоднородная инжекция носителей в нанослоях InGaN // ФТП, **39**(2), сс. 264-268 (2005).
- [6] Н.И. Бочкарева, А.А. Ефремов, Ю.Т. Ребане, Р.И. Горбунов, А.В. Клочков, Ю.Г. Шретер. Неоднородность инжекции носителей заряда и деградация голубых светодиодов // ФТП, 40(1), сс. 122-127 (2006).
- [7] А.А. Ефремов, Н.И. Бочкарьова, Р.И. Горбунов, Д.А. Лавринович, Ю.Т. Ребане, Д.В. Тархин, Ю.Г. Шретер. Влияние джоулевого разогрева на квантовою эффективность и выбор теплового режима мощных голубых InGaN/GaN светодиодов // ФТП, 40(5), сс. 621-627 (2006).
- [8] Г.А. Сукач, П.С. Смертенко, П.Ф. Олексенко, Suji Nakamura. Анализ температуры перегрева активной области зелених СИД на основе нитридов III группы // ЖТФ, 71(4), сс. 76-79 (2001).
- [9] А.Н. Ковалев, Ф.И. Маняхин, В.Е. Кудряшов, А.Н. Туркин, А.Э. Юнович. Изменения люминесцентных электрических свойств светодиодов из гетероструктур InGaN/AlGaN/GaN при длительной работе // ФТП, **33**(2), сс. 224-232 (1999).
- [10] Н.И. Кузнецов, К.G. Irvine. Вольт-амперные характеристики GaN и AlGaN *p-i-n*-диодов // ФТП, **32**(3), сс. 369-372 (1998).
- [11] А. Берг, П. Дин. Светодиоды. Мир, М. 686 с. (1979).
- [12] А.А. Скворцов, А.М. Орлов, В.А. Фролов, А.А. Соловьев. Электростимулированное движение краевых дислокаций в кремнии при комнатных температурах // ФТТ, **42**(11), сс. 1998-2003 (2000).
- [13] G. Harman. Semiconductor measurement technology: nondestructive tests used to insure the integrity of semiconductor devices with emphasis on acoustic emission techniques // International Advances in Nondestructive Testing. New York, Vol.7, pp. 105-179 (1981).
- [14] O.V. Lyashenko, V.M. Perga. Acoustic emission for the diagnostic of semiconductor structures // Diagnostic Techniques for Semiconductor Materials Processing, MRS Proc., Boston, 406 pp. 449-456 (1996).

- [15] О.В. Ляшенко, В.М. Перга, В.А. Тхорик. Связь электрических шумов с акустической эмиссией в элементах оптоэлектроники // *Тез. Докл. Координ. Совещ. Соц. стран по физ. пробл. оптоэлектроники*. Баку, с. 89 (1989).
- [16] В.П. Велещук, О.В. Ляшенко. Акустична емісія світловипромінювальних структур на основі сполук А³В⁵ обумовлена постійним прямим струмом // УФЖ, 48(9), сс. 941-945 (2003).
- [17] В.П. Велещук, О.В. Ляшенко, Ю.О. Мягченко, Р.Г. Чуприна. Эволюция спектров электролюминесценции и акустическая эмиссия эпитаксиальных структур GaAsP // Журнал Прикладной Спектроскопи, 71(4), сс. 508-511 (2004).
- [18] T. Ikoma, M. Ogura, Y Adachi. Acoustic-emission study of defects in GaP light-emitting diodes // *Appl. Phys. Lett.*, **33**(5), pp. 414-415 (1978).
- [19] S. Noriyuki. The effects of thermal stress on the temperature dependence of degradation in GaAs_{0.9}P_{0.1} operating at high current densities // J. Appl. Phys., **51**(3), pp. 1818-1824 (1980).
- [20] O. Ueda, H. Imai, T. Fujiwara S. Yamakoshi. Abrupt degradation of three types of semiconductor light emitting diodes at high temperature // J. Appl. Phys., 51(10), pp. 5316-5325 (1980).
- [21] В.В. Евстропов, М. Джумаева, Ю.В. Жиляев, Н. Назаров, А.А. Ситникова, Л.М. Федоров. Дислокационное происхождение и модель избыточно – туннельного тока в *p-n-* структурах на основе GaP // ФТП, 34(11), сс. 1357-1362 (2000).
- [22] В.В. Евстропов, Ю.В. Жиляев, М. Джумаева Н. Назаров. Тунельно-избыточный ток в невырожденных барьерных *p-n-* и *m-s-* структурах А³В⁵ на Si // ФТП, **31**(2), сс. 152-157 (1997).
- [23] В.К. Дубовий, В.І. Кочкін, В.Я. Опилат, І.В. Петренко, В.П. Тартачник. Вплив нейтронного опромінення на зворотні струми фосфідо-галієвих світлодіодів // УФЖ, **52**(2), сс. 175-179 (2007).
- [24] І.В. Коляденко, П.Г. Литовченко, В.Я. Опилат І.В. Петренко, В.П. Тартачник, В.І. Хіврич. Деградація фосфідо-галієвих світлодіодів, обумовлена радіаційними дефектами // Фізика і хімія твердого тіла, 7(1), сс. 184-188 (2006).
- [25] [С.М. Зи. Физика полупроводниковых приборов. Мир, М. 456 с. (1984).
- [26] Г.Ф. Матаре. Электроника дефектов в полупроводниках. Мир, М. 463 с. (1974).
- [27] K.I. Ashley, A.G. Milnes Double injection in deep-lying impurity semiconductors // J. Appl. Phys., 35(2), cc. 369-374 (1964).

V.P. Veleschuk¹, O.I. Vlasenko¹, O.V. Lyashenko², A. Baidullaeva¹, B.K. Dauletmuratov¹

Acoustic Emission and Changes of Luminescent and Electrical Characteristics of InGaN/GaN Heterostructures at the Current Loading

¹V. Lashkaryov Institute of semiconductor physics, NAS of Ukraine, 03028, Kyiv, prosp Nauky 41 ²Taras Shevchenko Kyiv National University, 03680, Kyiv, prosp. Glushkova, 2/1 E-mail: vvvit@ukr.net

In the paper correlation of acoustic emission occurrence and changes of luminescent and electrical characteristics of InGaN/GaN heterostructures have been revealed at loading a forward direct current that indicates their common mechanism of an origin. It is shown, that the amount of acoustic emission sources in InGaN/GaN heterostructures at flowing of critical density of a direct current depends on temperature and considerably increases with growth of temperature.